



自動マクロ検査装置

AMI-5600/3500/3000 MarkII



自動マクロ検査装置 AMI-5600/3500/3000 MarkII

AMIは、高スループットと卓越した検出感度を共に実現する自動マクロ検査装置です。目視マクロ検査の自動化への置き換えを実現するだけでなく、マクロ検査の精度向上や検査の定量化・明確化を図り、より効率的なプロセス管理を可能にします。

主な特長

- ニコン独自の回折光受光システムにより、特に露光機のデフォーカス、コーターによる塗布ムラなど、Z軸方向のパターン変動を高感度で検出。また、最上層パターンの回折光のみを的確に捉え、マクロ検査で問題となる下地欠陥との識別が可能。
- AMI-5600では、新しいミラー傾斜光学系により下層ノイズを低減。
- 15 μ mのゴミ（微小異物）を検出。
- ウェハ全数全面一括検査を可能とし、高スループット（170枚／時）を達成。
- 良品ウェハの持つ良品範囲をその特徴量として捉える「良品学習機能」を備えたAI画像処理を採用。大きなプロセス変動に対しても、レシピのリチューニングを必要とせず、擬似欠陥の発生を防止。
- 優れた自動レシピ作成機能により、習熟したオペレータ以外でも、短時間で最適なレシピ作成が可能。
- ADC（自動欠陥分類）機能に加え、カスタマー固有のリワーク判定基準をレシピ設定することで、リワーク判別の自動化も可能。
- ホール工程検査にも対応。

仕様

- 3Xnm、2Xnm、1Xnm（AMI-5600のみ）リソグラフィー対応
- 3Dメモリ/LOGIC/CMOSイメージセンサーデバイスに適用
- PER（パターンエッジラフネス）検出機能およびミラー傾斜光学系搭載（AMI-5600のみ）



安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご 注 意

本製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等（特定技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

●このカタログは2020年11月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。

●このカタログに掲載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

©2020 NIKON CORPORATION

<http://www.nikon.co.jp/pec>

株式会社 **ニコン**

半導体装置事業部 事業企画部 108-6290 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟 電話(03)6433-3639

株式会社 **ニコンテック** 140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル 電話(03)5762-8911